

Plasma Germany

Fachausschuss Normung

Bericht Frühjahrssitzung 2012, Stuttgart

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.



Normenausschuss Materialprüfung (NMP)

die Ergebnisse des durchgeführten Projekts "Klassifizierung und Eigenschaftsprofile sowie Anwendungsgebiete von Kohlenstoffschichten" im Rahmen des Programms Innovationen mit Normen und Standards (INS) haben gezeigt, dass insbesondere die Klassifizierung und Benennung der Kohlenstoffschichten seitens der Industrie und Forschung international vereinheitlicht werden sollten.

Auf der internationalen Ebene wurde von Japan Ende Januar ein Vorschlag für die Erarbeitung einer Norm zum Thema Kohlenstoffschichten eingebracht. Da derzeit noch kein nationaler Arbeitsausschuss zum Thema Kohlenstoffschichten beim DIN existiert, ist momentan keine Mitarbeit an der jetzt angekündigten internationalen Normung möglich. Vor diesem aktuellen Hintergrund und den ersten positiven Rückmeldungen Interessierter Kreise aus dem INS- Projekt verfolgt das DIN die Absicht, zur Thematik "Kohlenstoffschichten" die Normungsarbeiten in Deutschland zügig aufzunehmen und ein nationales Spiegelgremium zu gründen. Hiermit möchten wir mit dem beigefügten Fragebogen alle Interessierten Kreise ansprechen und bitten um Rückmeldung bis zum

13. April 2012

Spiegelgremium zu ISO/TC 172/SC 3/WG 2 Optical coatings

- **DIN 58197-1 bis -4:2002** „Dünne Schichten für die Optik“
Teil 1 bis 4
Turnusmäßige Überprüfung läuft derzeit
- **E DIN ISO 911-2** "Optik und optische Instrumente - Dünne Schichten für die Optik - Teil 2: optische Eigenschaften"
zum Druck verabschiedet (Einspruchsfrist bis 6. Juni 2012)
- Beratung zu einem **neuen Normungsvorhaben**:
"Bestimmung der Haftfestigkeit dünner Schichten mittels Zentrifugenversuch"
Vorschlag zu Validierungsversuchen erarbeitet

- **NA 092-00-28 "Qualitätssicherung von **Klebungen**"**
Gründungssitzung, 12. März 2012 in Berlin
- **NA 043-02-01 Maßnahmen gegen **Produktpiraterie****
nächste Sitzung 12. Juni 2012 in Berlin

NA 062-08-16 AA

„Chemische Oberflächenanalyse und Rastersondenmikroskopie“

Obmann: Dr. W. **Unger** (BAM, Berlin)
Stellv. Obfrau: Dr. B. **Hagenhoff** (TASCON GmbH, Münster)
Bearbeiter im DIN: Dr. M. Schmitt

Spiegelausschuss für ISO TC 201.

**Deutschland ist stimmberechtigt in allen SCs von TC 201
 (P-Membership)**

**Der Spiegelausschuss ist immer offen für weitere Mitarbeiter aus
 Industrie und Forschungsinstituten!**

ISO/TC 201 Surface Chemical Analysis

Alle Normen und Normungsprojekte auf:

http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees.htm

Recent topics:

Terminology, XPS, AES, SIMS, SPM

Future topics:

1. Spectroscopic ellipsometry
2. **Nanoparticles** (important for both ISO TC 201 and TC 229)
3. Desorption electrospray ionisation (DESI).
4. Tip enhanced Raman spectroscopy (TERS).
5. Matrix-assisted Laser-Desorption/Ionisation MS (MALDI)
6. Analysis of **BioSurfaces**.
7. Multivariate analysis.

VAMAS

(Versailles Project on Advanced Materials and Standards)



Chairman: Dr. Ian S. Gilmore, NPL, UK

Teilnehmer: G20 Staaten + EU

**TWA 2 führt pränormative Forschung für ISO/TC 201
durch, z.B. Ringversuche:**

Proposed new project

International Round Robin **Test for Graphene Layer-number**

Characterization by Kelvin Probe Force Microscopy

NA 062-08-18 AA „Elektronenmikroskopie und Mikrobereichsanalyse“

Obmann: Dr. V.-D. Hodoroaba (BAM, Berlin) - wiedergewählt

Stellv. Obmann: Hr. O. Fiedler (eumeX Instrumentebau GmbH, Heidenrod)

Bearbeiter im DIN: Dr. M. Schmitt

Spiegelausschuss für ISO/TC 202

Deutschland ist stimmberechtigt in allen SCs von TC 202

(P-Membership)

**Der Spiegelausschuss ist immer offen für weitere Mitarbeiter aus
Industrie und Forschungsinstituten!**

ISO/TC 202 Microbeam Analysis

Alle Normen und Normungsprojekte auf:

http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees.htm

Actual topics:

- Terminology,
- Electron Backscatter Diffraction (EBSD),
- Image sharpness,
- X-Ray spectra format,
- X-Ray Spectrometer Check

[Home](#) > [Technical Working Areas](#) > Quantitative Microstructural Analysis

TWA 37

Quantitative Microstructural Analysis

The objective of this TWA is to develop harmonised test procedures for quantitative microstructural analysis using microbeam instruments such as a transmission electron microscope, scanning electron microscope and electronprobe microanalyser.

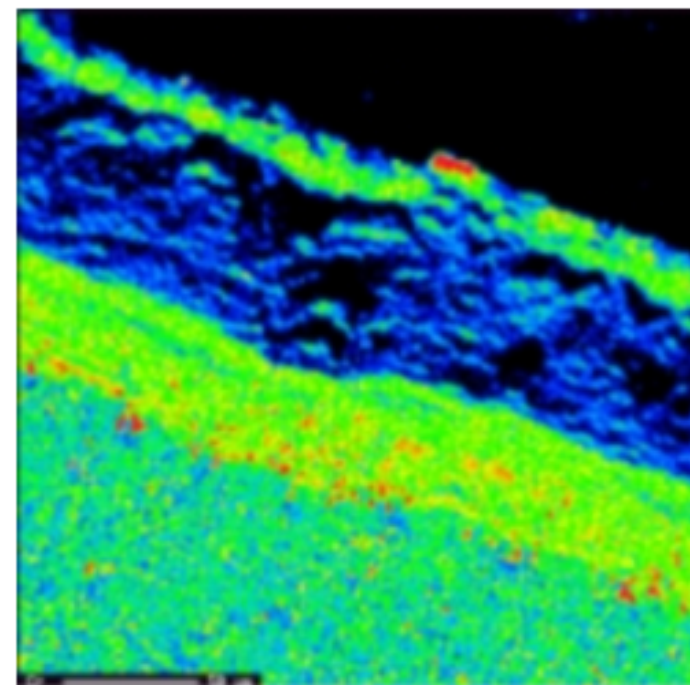
Activities will include interlaboratory comparison studies of measurement methods and pre-normative research required for the development of robust international standards. The main output for the work will be to support the work of [ISO TC202](#) on Microbeam Analysis.

PROJECT 1 : [Determination of reproducibility and repeatability of grain size measurement by Electron Back Scattered Diffraction \(EBSD\)](#)

PROJECT 2 : Investigation of sharpness of scanning electron microscope (SEM) images

More information

Dr. Jürgen Lexow (juergen.lexow@bam.de) +49 30 8104 1004



DIN NA 062-08-17 Nanotechnologien

(Spiegelung ISO/TC 229 Nanotechnologies +
CEN/TC 352 Nanotechnologies)

planned NWIP:

ISO/TS 80004-x Vocabulary - Terminology and Definitions for **nanocoatings, nanofilms, nanolayers and related terms**

draft will be presented at the next ISO/TC 229 meeting in Stresa (11.-15. Juni 2012)

soll in enger Abstimmung mit

- *ISO/TC 35 Paints & Varnishes*
 - *ISO/TC 256 Pigments, dyestuffs and extenders*
- bearbeitet werden.*

„Nanomaterial“:

A natural, incidental or manufactured material containing particles, in an unbound state or as an aggregate or as an agglomerate and where, for **50 % or more of the particles** in the number size distribution, one or more external dimensions **is in the size range 1 nm - 100 nm.**

*In specific cases and where warranted by concerns for the environment, health, safety or competitiveness the number size distribution threshold of 50 % **may be replaced by a threshold between 1 and 50 %.***

*By derogation from the above, **fullerenes, graphene flakes and single wall carbon nanotubes with one or more external dimensions below 1 nm** should be considered as nanomaterials.*

adopted On 18 October 2011

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Quelle: www.begann.de/